

MiniQRシリーズ 減圧弁

超高純度ガス対応
ライン用レギュレータ



パーカーハネフィン社 インストゥルメンテーショングループ ヴェリフロデベジションにて製造されている MiniQRシリーズ 減圧弁は高純度ガスを用いる、半導体又は液晶製造装置、半導体製造設備などが要求する、腐食性ガス、毒性ガスを始めとする厳しい流体に対し優れた性能を発揮するよう設計されています。

又その小型のサイズはスペースの問題を解決するだけではなく、ヴェリフロが長年に渡り培った生産技術により優れた信頼性を提供致します。

VMBのアプリケーションはもちろんのこと、半導体製造に関連する様々なガス圧制御に対し卓越した 安定性、感度、再現性、履歴性などを提供することにより、システムのさまざまな問題を解決し、信頼という価値を提供いたします。



特徴

- ・コストと性能を両立させた革新的なポペット構造
- ・接ガス部にネジ部のないクリーン設計
- ・ハステロイC - 22ダイアフラムの標準採用にて腐食性ガスにも対応
- ・標準にて10Ra電解研磨
- ・小型設計で内容積・内面積を最小化
- ・最大二次圧1.7MPaまで対応可
- ・幅広い流量範囲と調圧範囲
- ・様々なシール方式の集積ユニットに対応可

材質仕様

接ガス部材質

ボディー : ウェリクリーン316Lss
シート : PCTFE
ダイアフラム : ハステロイC-22
ホベット : インコネル X750
コンプレッションメンバー : ウェリクリーン316Lss

非接ガス部材質

キャップ : ニッケルメッキプラス
ノブ : ABSプラスチック

操作仕様

最大入力圧力 : 3.5MPa
二次側調圧範囲 : -0.07 ~ 0.7MPa
(最大1.7MPaも可)
温度範囲 : -40 ~ 66

表面処理

ボディー接ガス部 : 10Ra 電解研磨

性能仕様

破壊圧力 : 5.3MPa
CV値 : 0.1
シートリーク値 : 5×10^{-8} scc/s
外部リーク値 : 2×10^{-9} scc/s
推奨最大流量 *1) : 50SLPM

内部容積

接ガス部容積 : 4.2 cc

標準対応継手

フェイスシール(VCR相当) : 1/4" オス/メス
W-Seal 1.5"集積 : 1.5"角
C-Seal 1.5"集積 : 1.5"角
B-Seal 集積 : 丸棒型

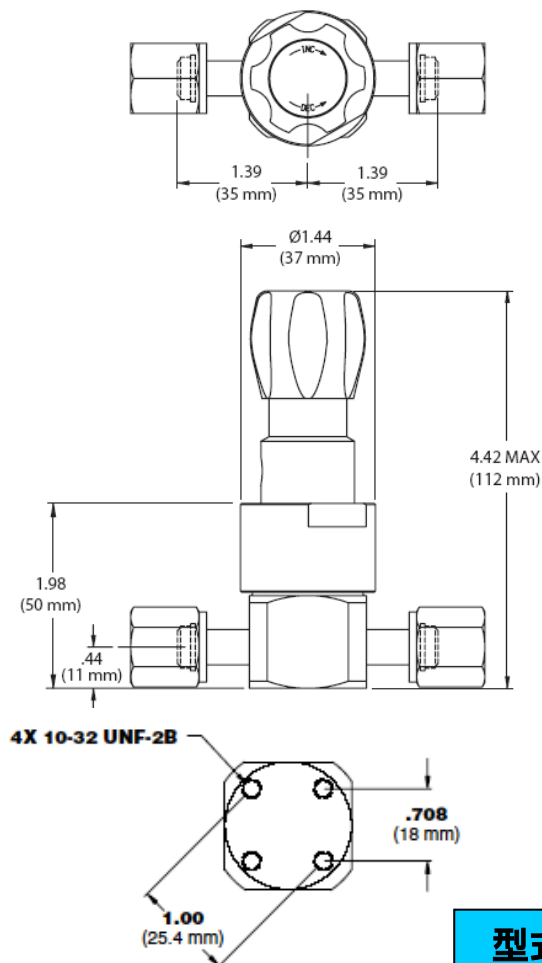
重量

概算重量 : 420 g

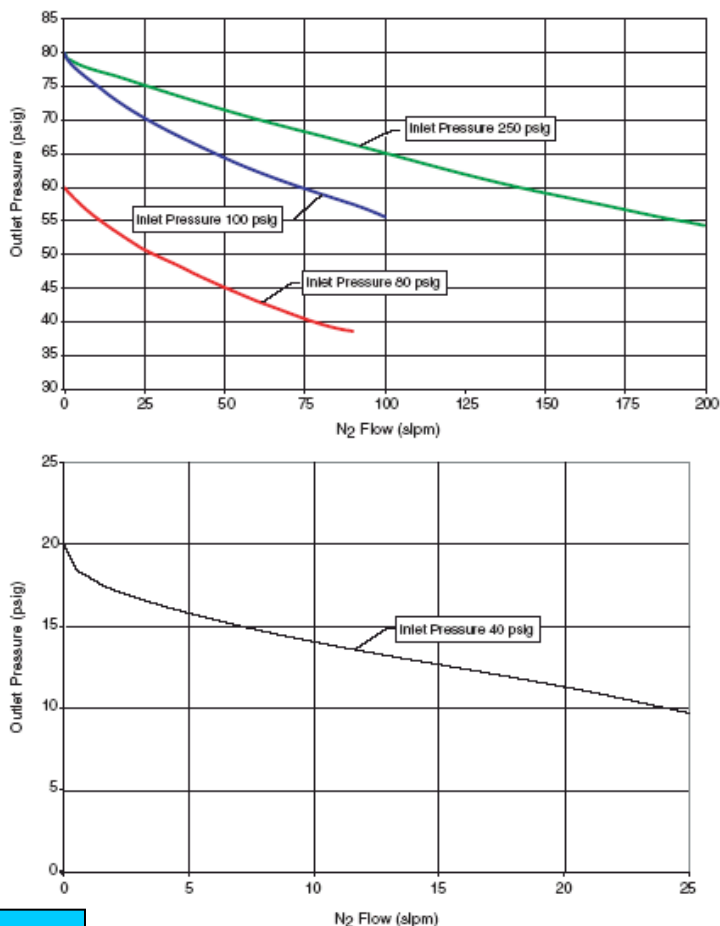
*最大流量は差圧、ガス種により異なりますので
詳細はメーカーに問い合わせ下さい

MiniQRシリーズ 減圧弁

寸法仕様



流量曲線



型式コード

QRM30 S 2P FS MF

BASIC SERIES

QRM30 = 250 Torr 30 psig
QRM60 = 1 - 60 psig
QRM100 = 2 - 100 psig
QRM250 = 3 - 250 psig

MATERIAL

S = 316L Stainless Steel

PORTING

2P = 2 Ports
3P = 3 Ports

OPTIONAL FEATURES

PA = 最大圧力表記 MPa

CONNECTIONS

M = Male

F = Female

それぞれのポートについてオス、メスを指定してください。

PORT STYLE

FS = 1/4" Face Seal

TS = 1/4" Tube Stub

OUTLET GAUGE

03 = 0 - 30 psig

OL = 0 - 60 psig

01 = 0 - 100 psig

2 = 0 - 200 psig

4 = 0 - 400 psig

X = ゲージ無し(2Pを除く)

注: ゲージ用ポートは面シールオスとなります。